PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2005-109933

(43)Date of publication of application: 21.04.2005

(51)Int.CI.

H01P 5/107 H01P 5/02

(21)Application number: 2003-341381

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

30.09.2003

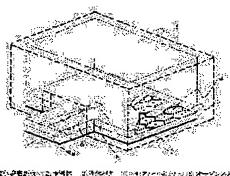
(72)Inventor: ONO YOSHIKI

OHASHI HIDEMASA TAWARA YUKIHIRO KODAMA KATSUHISA

(54) CONVERSION CIRCUIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a thin waveguide and a dielectric microwave transmission line conversion circuit. SOLUTION: The conversion circuit is composed of a ground conductor formed to one face of a first layer of a dielectric multilayered substrate, a conductor pattern similarly and regularly arranged to the other face of the first layer of the dielectric multilayered substrate, a plurality of through-holes for connecting the ground conductor and the conductor pattern, an open stub formed to the uppermost layer of the dielectric multilayered substrate, and a microwave transmission line which is formed to the uppermost layer of the dielectric multilayered substrate extended to the outside of the waveguide via a part where the waveguide is partially notched and connected with the open stub.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

に成れ	上記弟 1の回に形成された型等体と上記等との固に形成された各々の毎体パターンを追 気的に接続するスルーホールと、 上記務電体多層基板の第3の面に形成されるオープンスタブと、 上記務電体多層基板の第3の面に形成されるオープンスタブと、 上記務電体多層基板の第3の面と直角で第3の面の外方向に延伸し、かつ上記務電体多層基板の第3の面側の側壁を、その端部から一部分を切り欠いた導放管と、 上記導改管の切り欠き部から導放管外に延在する誘電体多層基板の部分でかつ第3の面 に形成され、切り欠き部で上記オープンスタブと接続されるマイクロ改伝送線路の導体と を備えることを特徴とする変換回路。	導波管と誘電体基板上に形成されたマイクロ液伝送線路とを接続する変換回路において、上記誘電体基板に誘電体多層基板を用い、その誘電体多層基板の第1の面に形成された地導体と、上記誘電体多層基板の第2の面に形成され、一定の間隔を有し規則的に配列された複数の多角形の導体パターンと、上記第1の面に形成された地導体と上記第2の面に形成された各々の導体パターンを電気的に接続するスルーホールと、上記第2の面に形成された40第3の面に形成された40第3の面に形成された40第3の面に形成された40第3の面に形成されるオープンスタブと、上記熱電体多層基板の第3の面に形成されるオープンスタブと、	上記跡電体多層基板の第3の面と直角で第3の面の外方向に延伸し、かつ上記跡配体多層基板の第3の面側の側壁を、その端部から一部分を切り欠いた導液管と、上記導液管の切り欠き部から導液管外に延在する跡電体多層基板の部分でかつ第3の面に形成され、切り欠き部で上記オープンスタブと接続されるマイク中液伝送線路の導体と上記跡電体多層基板の第2の面と第3の面の間に第4の面を形成し、この第4の面の導液管外延在部分に第2の地導体を設け、この第2の地導体と第1の面に形成された地導体とを電気的に接続する第2のスルーホールを設けたことを特徴とする変換回路。「建設第3	NBC 2017 NBC	【請求項5】 導液管の内部の誘電体基板上に形成されるオーブンスタブは、複数の導体パターン幅を 有する形状にされたことを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の変換回路。 【請求項6】 マイクロ波伝送線路の導体は、複数の導体パターン幅を有する形状にされたことを特徴 とする請求項1乃至5の何れかに配載の変換回路。 【請求項7】 誘電体多層基板の第3の面に導波管の端面を接続し、誘電体多層基板の第3の面でこの 誘電体多層基板の第3の面に導波管の端面を接続し、誘電体多層基板の第3の面でこの
特許顧	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 大橋 英征 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 田原 志浩 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内	5.13 5.14 5.74 4.23	010	4	
(整理番号] 647579] (整理番号] 547579] (提出日) 平成 年 (あて先) 特許庁長官殿 (国際特許分類) H01P 5 (発明者) 東京都千代田区 (任所又は居所) 東京都千代田区 (最高条) 大野 新樹	1 居所] 1.居所] 1.居所]	【特許出願人】 【範別番号】 00000601 【氏名又は名称】 三菱電機株式会社 【代理人】 10005787 【辞理士】 管我 道照 【充名又は名称】 曾我 道照 【強別番号】 10011042	「弁理士】 【氏名又は名称】 曾我 道治 【遊日七七代理人】 1000840 【辞理士】 1000840 【氏名又は名称】 古川 秀利 【職別番号】 1000946	5称】 鈴木 海七人】 100111 8称】 梶並 順 暗号》 000181	【熱付金額】 21000 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 (物件名】 【物件名】 明細醇 (物件名】 【物件名】 図面 【物件名】 要約串

導液管と接触する部分に導体を設け、この導体と上記第1の面に形成された地導体とを電気的に接続する複数のスルーホールを設けたことを特徴とする請求項1乃至6の何れかに 記録の校検回路。

体とを電気的に接続する複数のスルーホールは、その横断面が導液管の内壁面に外接する 位置に設けられたことを特徴とする請求項7記載の変換回路。 誘砲体多層基板の導波管との接触面に設けられた導体と上記第1の面に形成された地導

[6 所外語]

体とを電気的に接続する複数のスルーホールは、その横断面が導液管の内壁面から一定距離離れた位置に設けられたことを特徴とする請求項7記載の変換回路。 誘電体多層基板の導波管との接触面に設けられた導体と上記第1の面に形成された地導

【題长母10】

導放管は断面形状が長方形を成し、誘電体多層基板の導放管との接触面部分に設けられた複数のスルーホールは、相対する2辺設けられた複数のスルーホールと、その2辺と直角を成す2辺設けられた複数のスルーホールとは導放管の内壁からの距離が異なるように設けられたことを特徴とする請求項7記録の変換回路。

【韻水項11】

水項7乃至10の何れかに記彙の変換回路。 体とを国気的に接続する複数のスパーホールは、 終電体多層基板の導液管との接触面に設けられた導体と上記第1の面に形成された地導 にとを電気的に接続する複数のスルーホールは、毎間隔に配置されることを特徴とする調

上記誘館体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体パターンは、そ正三角形とすることを特徴とする調求項1乃至11の何れかに記載の変換回路。

開來項13]

上記録電体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体パターンは、 を四角形とすることを特徴とする請求項1乃至11の何れかに記彙の変換回路。 [請求項14 **やの歩**装

上記誘電体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体パターンは、を正六角形とすることを特徴とする朝求項1乃至11の何れかに記載の変換回路。

[請求項15

の変換回路。 上記誘電体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体パターンは、その形状を避形の対角線長辺の端部を中心として120度回転させて配列した3つの菱形を回転の中心点で接続した導体パターンとすることを特徴とする請求項1乃至11の何れかに記載

[韶块母16]

上記誘電体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体パターンは、その形状が2つ以上の異なる形状とされたことを特徴とする請求項1乃至11の何れかに記彙の変

【韶米母17】

上記瞭電体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体パターンが正三角形と正六角形を成すことを特徴とする間求項16記載の変換回路。 屰

上記誘電体多層基板の第2の面に形成された複数の多角形の導体バターンは、が四角形と八角形を成すことを特徴とする請求項16記載の変換回路。

発明の名称

000

形成されたマイクロ 【背景技術】 この発明は、マイクロ波やミリ波等の高周波伝送に用いられる導波管と誘電体基板上に成されたアイクロ波伝送線路とを接続する変換回路に関するものである。

0002]

導液管と誘電体基板上に形成されたマイクロ液伝送線路との変換回路として、例えば特別平6-140816号公報に示された変換回路がある。この変換回路では導液管とマイクロストリップ線路との構成例が示されている。上記従来の装置では、オープンスタブを形成した誘電体基板を導液管の一部を除去した側面より導液管内に挿入し、上記誘電体基板の下部に導液管による空洞部位を設ける構成とすることにより変換回路を構成している

0003]

て反射する。反射するマイクロ波の位相は入力される位相に対し180度の位相差を持つ。このため、空洞端面部より導液管管軸方向に約4分の1波長離れた地点では、同位相となり入反射液の干渉により強めあうこととなる。このため、前述の位置にオープンスタブを形成した誘電体基板を挿入し、このオープンスタブを誘電体基板上に形成されるマイクロ液伝送線路に導液管の一部を切除した部分を介して接続することで、導液管から誘電体基板のマイクロ液伝送線路に入力液の伝送路を変換することが可能となる。尚、実際には誘電体基板を挿入することにより同位相となる位置は上述の長さと異なるが、入射液と反射液とが同相となる位置を適宜設定することにより、変換回路として動作する。 導波管より入力されたマイクロ波は誘電体基板の下部に構成される空洞部位の場面部に の従来の構成において、導放管よりマイクロ波を入力した場合について説明を行な

0004]

【特許文献1】 特開平6-140816号公報

発明の開示

発明が解決しよう とする課題

0005

場合には、導液管の内部に挿入される部分には細門はるの品がでも、ってして、これである時代をはあった。さらに、誘電体基板にスルーホールを形成し、上記誘電体基板を導放管で上下から挟み込んで変換回路を構成する場合においては、上下の導液管の内壁位置メレが発生し変換回路の特性を劣化させるという問題点もあった。 従来の変換回路は、誘電体基板の下部に導放管による空洞部位を設ける構成となってお、構成全体の厚みが増加するという問題点があった。また、多層の誘電体基板を用いた合には、導放管の内部に挿入される部分には如何なる配線をもすることができないとい

この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、誘電体基板の下部の空間のない薄型の変換回路を得ることを目的とする。また、多層の誘電体基板を用いた合には変換回路の下層に高周波線路、電源や制御信号の配線が可能となる変換回路を得ことも目的としている。

【課題を解決するための手段】 【0007】

この発明に係る変換回路は、 誘電体基板に誘電体多層基板を用い、その誘電体多層基板の第1の面に形成された地導

多角形の蹲体パターソア 記跡館体多層基板の第2の面に形成され、 所定の間隔を有し規則的に配列された複数

気的に接続するスプーホープと、 上記第1の面に形成された地導体と上記第2の面に形成された各々の導体パターンを電

上記跡電体多層基板の第3の面に形成されるオープンスタブと、 上記跡電体多層基板の第3の面と直角で第3の面の外方向に延伸し、かつ上記跡電体多層基板の第3の面側の側壁を、その端部から一部分を切り欠いた導波管と、 上記導政管の切り欠き部から導政管外に延在する誘電体多層基板の部分でかつ第3の面に形成され、切り欠き部では電水ープンスタブと接続されるマイクロ波伝送線路の導体と を値える。

[発明の効果]

8000]

この発明によれば、誘電体多層基板の下部に導波管空洞部位が存在しなくても、を伝播するマイクロ波を誘電体基板上に形成されたマイクロ波伝送線路へ変換し、 ることができる。

[発明を実施するための最良の形態]

6000]

実施の形態1

区ににいる場の実施の形態1を示す変換回路の構成図である。 図1において、1は第一の務電体基板と第二の務電体基板とが重ねて形成された誘電体 図1において、1は第一の務電体基板と第二の務電体基板とが重ねて形成する第一の務電体基 多層基板で3つの導体圏を有する。2は上記務電体多層基板1を形成する第一の務電体基 板の一方の面、即も務電体多層基板1の第1の面全面に設けられた第1層目の導体層であ る地導体、3は上記務電体多層基板1を形成する第一の誘電体基板の第二の誘電体基板に 面する面即も誘電体多層基板1の第2の面、全面に規則的に配列された複数の多角形導体 である単体パターン3を各々電気的に接続するためその表面が金属メッキされた複数のスルーホールである。5は上配務電体多層基板1を形成する第二の誘電体基板の第一の誘電体基板に面する反対側の面、即ち誘電体多層基板1の第3の面に形成された第3層目の導体層であるオープンスタブで、2段階に幅の異なる長方形を成している。6は上記誘電体多層基板1の第3の面と垂直で第3の面の外方向に延伸する単波管であり、その側面は端 パターンでこの実施の形態では正六角形を成している。4は上記統電体多層基板1を形成する第一の銃電体基板に設けられた第1層目の導体層である地導体2と第2層目の導体層 節から一部を切り欠いた部位7を有する。

[0010]

大き配位7から導波管6外に延在する長方形の延在部分が一体形成されている。上記勝電体多層基板1に形成された第3層目の導体層であるオープンスタブは上記導波管の一部を切り欠いた即位7を介して、上記誘電体多層基板1の延在部分上に形成されたマイクロ波伝送線路8の導体8aと接続される。この導体8aは2段階に幅の異なる長方形を成している。また、上記の地導体2は上記終電体多層基板1の延在部分全面に延伸して形成され 上記跡電体多層基板1は、導波管6の管軸方向と直角な導波管内面の形状を成し、

上記マイクロ波伝送線路8は誘電体多層基板1の最上面に構成された導体8gと誘電体多層基板1の下面に形成された地導体2により構成され、マイクロストリップ線路とも言

「0011] このように構成された変換回路において、導液管6よりマイクロ液を入力する場合についてのように構成された変換回路において、導液管6よりマイクロ液は務電体多層基板1に構成された地導体2及び規則的に配列された複数の導体パターン3により反射される。上記導体パターン3を務電体多層基板1に形成し、その導体パターンと、地導体2とをスルーホール4にて接続し、これらの導体を規則的に務電体基板平面上に配列することにより、特定の周波数において入射波と反射波の位相が同和となる磁気壁面として作用する。所望の周波数でおいて入射波と反射波の位相が同和となる磁気壁面として作用する。所望の周波数で、誘電体多層基板1に形成されるオープンスタブ5の上面において入射波及び反射波ので、誘電体多層基板1に形成されるオープンスタブ5の上面において入射波及び反射波の 位相が同相となるように導体パターン3の大きさ、隣接する導体パターン3との間隔及びスルーホール4の直径を適宜設定する。このようにして設定されたパラメータで構成され **導放管 6 より入力するマイクロ波は導波管 6 の一部を切り欠いた部位** る変換回路では、

和 して誘電体多層基板1上に形成されたマイクロ波伝送線路8〜伝送路が変換され、

[0012]

一ル4の直径を0.01710、上記正六角形間隔を0.00710とする。上記正六角形の導体パ 次に具体的な事例をあげて説明を行なう。設計中心周波数f0における波長を10とし、 誘電体多層基板1に形成される導体パターン3の正六角形の一辺を0.06810、スルーホ し、豚電体基板 ターン3と地導体2の間隔、即ち第一の骸電体基板の厚みは0.03310と には比断電率3.39の基板を用いているものとする。

0013

綠路への接続を有しない構成としている。また、図3はこの場合の誘電体多層基板1の最上面における反射位相特性9を示したグラフである。設計中心周波数f0において反射位相 が0度近傍となり、規則的に配列された導体パターン3をスルーホール4を介して地導体2に接続することにより磁気壁面として動作していることがわかる。尚、規則的に配列された複数の導体パターン3は導波管6の内盤寸法で切り取られた形状となっており、誘電 マイクロ故伝送 図2は上記実施の形態1における磁気壁面の動作確認用の構成であり、 体多層基板 1 の端部まで配列されている。

[0014]

上記規則的に配列された導体パターン3を有する構成を変換回路に適用した事例の反射等性10を図4に示す。おおよそ設計中心周波数f0において反射係数が低くなっており、導波管6から入力されたマイクロ波が誘電体多層基板1上のマイクロ波伝送線路8に変換 、伝送されていることがわかる。

[0015]

以上のような構成とすることにより、誘電体多層基板1の下部に導放管空洞部位が存在しなくても、導政管を伝播するマイクロ波を誘電体基板上に形成されたマイクロ波伝送線路へ変換し、伝送することができる。

[0016]

また、実施の形態1においてはオープンスタブ5、及び誘電体多層基板1上に形成されるマイクロ效伝送線路8の導体8a夫々に複数の幅の導体を用いているが、いずれか一方又は双方が均一な導体幅であっても構わないことは云うまでもない。これらに複数幅の導体を用いることにより複数の周波数及び周波数帯域幅を調覧するこ

とが可能となる。

また、誘電体多層基板1にn層 (nは4以上)の導体層を有する多層基板を適用し、任 意の3つの導体層を上述の如き構成とすることにより変換回路を構成することが可能であ [0017]

ることは云うまでもない。 即ち、上記跡電体多層基板1の各跡電体基板の間にマイクロ波回路や電源信号用及び制 御信号用等の回路基板が押入されていても、また地導体2の下部にマイクロ波用や電源信 号用及び制御信号用等の回路基板が追加して設けられていても同様な効果を奏する。

実施の形態2 0018]

上記の実施の形態では、誘電体多層基板1の任意の3つの導体層を用いて変換回路を構成した場合であったが、誘電体多層基板1の任意の4つの導体層を用いて変換回路を構成することにより誘電体基板の層構成の自由度を増すことができる。図5に実施の形態2の

この実施の形態2は、筋電体多層基板1を形成する第一の筋電体基板と第二の筋電体基板との間に第三の筋電体基板を設け、この第三の筋電体基板の上面を第4の面とし、この第4の面でかつ誘電体多層基板1の導液管外延在部分に第2の地導体12を設け、第1の面に形成される地導体12と複数の第2のスル ーホール11により接続した構成としたものである。なお、この実施の形態では、第1の に形成される地導体2は延在部分全面まで、延伸してはおらず延在部分の終端から所定

の部分は地導体2が存在しない構成にされている。 その他は上記図1に示す構成と同様

この様な層牌成とすることにより、マイクロ波伝送線路8の誘電体基板の厚みを自由に設定することが可能となり、製造に最適な導体幅を有するマイクロ波伝送線路8を形成す ことができる。

0019

また、実施の形態2においてもオープンスタブ5、及び誘電体多層基板1上に形成されるマイクロ液伝送線路8の導体8 a に複数の幅の導体を用いているが、いずれか一方又は双方が均一な導体幅であっても構わないことは云うまでもない。 これらに複数幅の導体を

用いることにより複数の周液数及び周波数帯域幅を調整することが可能となる。 また、誘電体多層基板1にn層(nは5以上)の導体層を有する多層基板を適用し、任 意の4つの導体層導体層を上述の如き構成のすることにより変換回路を構成することが可 であることは云うま

0020

実施の形態3.
上記実施の形態3.
上記実施の形態2では、誘電体多層基板1の延在部分上第3の面に形成された導体8 a 上記実施の形態2では、誘電体多層基板1の延在部分上第3の面に形成された導体8 a と誘電体多層基板1の第1の面に形成された地導体2及び誘電体多層基板1の第4の面に形成された第2の地導体12により構成されるマイクロ液伝送線路8を用いているが、この実施の形態では、上記構成に加え誘電体多層基板1上に形成された導体8 a とオープンスタブ5の上、即ち、誘電体多層基板1の第3の面の上にさらに誘電体基板を重ね、この誘電体基板上で上記導体8 a を基準面にして第2の地導体12と対称となる位置に新たな5第3の地導体13を設け、この地導体13は第2の地導体12及び地導体2とスルーホール11により接続される構成としたマイクロ液伝送線路8による変換回路とすることが なが、

0021]

に填体パターン3の大きさ、隣接する導体パターン3との間隔及びスルーホール4の直径を適宜設定する。このようにして設定されたパラメータで構成することにより、マイクロ設伝送線路8の上部空間への放射や空間を介した他のマイクロ波デバイスとの結合を抑圧することが可能となる。また、務電体多層基板1下部だけでなく上部方向へも薄型の構成とすることができる。 図6に実施の形態3の構成図を示す。実施の形態3は誘電体多層基板1に形成するマイクロ液伝送線路8の単体8 e を基準面として、対称面に設けられた異なる2つの地導体12及び13によりトリプレート線路と自われるマイクロ液伝送線路を構成する。前述の変換回路と同様にオープンスタブ5を形成する単体層において、反射位相が0度となるよう

0022]

上記説明では全ての地導体2、12、13をスルーホール11で接続する構成としたが、マイクロ液伝送線路を構成する地導体12及び13と誘電体多層基板1の第1層の導体を构成する地導体2とを接続するスルーホールが異なる構成であっても構わない。また、上記スルーホールを導電性金鳳結合機器、例えばネジ等で代用しても同様の効果が得られることは言うまでもない。また、オープンスタブ5上に誘電体基板を積層する構成としたが、オープンスタブ5上に誘電体基板であっても構わない。

0023]

の問隔を有しマイクロ波伝送線路8の導体8gを対称線とし、異なる2つの地導体14g 及び14bによって構成されるコプレナ線路と言われるマイクロ波伝送線路8とする構成 及び146によって構成されるコプレナ!とした変換回路である。 路8を用いているが、本実施の形態は誘電体多層基板1の第3の面上に形成されたマイクロ液伝送線路8の導体8mと同一面に成形され、マイクロ液伝送線路8の導体8mと所定 実施の形態4. 上記実施の形態1では、勝電体多層基板1の延在部分上第3の面に形成された導体8 a 上記実施の形態1では、勝電体多層基板1の延在部分上第3の面に形成された導体8 a

図7に実施の形態4の構成図を示す。このような構成とすることにより、マイクロ液伝送線路8の導体8 a 上にマイクロ液部品、例えば抵抗や集積回路等を実装する際に必要となる地導体接続面をマイクロ液伝送線路の導体8 a と同一面に有することができるため、なる地導体接続面をマイクロ液伝送線路の導体8 a と同一面に有することができるため、容易に接続することが可能となる。また、実施の形態2及び実施の形態3で必要であった長下面に構成される地導体と接続するスルーホールが不要となる効果もある。さらには、スルーホールを不要とすることにより、誘電体多層基板1内の配線自由度が増すという効

[002

上記名実施の形態では、地導体2、導体パターン3、オープンスタブ5等を備えた誘電体多層基板1は減液管6の管内に配置される構成としていたが、この実施の形態は誘電体多層基板1の上面で導液管6と接続する構成とした変換回路である。図8に実施の形態は跨電体多層基板1の上面で導液管6と接続する構成とした変換回路である。図8に実施の形態5の構成図を示す。誘電体多層基板1の導液管6との接続面(導液管6の肉厚に相当する部分)に導体15を形成し、上記導体15と上記誘電体多層基板1の第1の面に形成される地導体2とを電気的に接続する複数個のスルーホール16を設ける。このような構成とすることにより複数のスルーホール16が導液管6の内壁の機能を果たし、複数のスルーホール16により複数のスルーホール16により複能的に導液管が形成される形となり誘電体多層基板1の外側に導液管が存在する構成と看板すことができる。また、誘電体多層基板1の上面で接続する構成とすることにより、誘電体多層基板1と導液管6の内壁との間に微小な隙間が発生することを防ぐ効果も得られる。

0026]

また、上記複数のスルーホール16を導液管6の内壁からの距離を適宜選択することにより、上記スルーホール16により構成される導液管のインピーダンスを可変とすることができ、変換回路の周波数特性を所望の値とするように設定することも可能となる。また、誘電体多層基板1と導液管6との接続部分の接続時における、配置位置ズレに対応した値とすることも可能である。また、上記複数個のスルーホール16に代わり、導電性金属結合機器、例えば金属ネジ等でも同様な効果が得られると共に、スルーホール16の直径及び配置間隔は全てが同一でなく、少なくとも1つ以上が異なる直径及び配置間隔であっても同様な効果が得られる。

0027

また、実施の形態5ではマイクロ波伝送線路8にマイクロストリップ線路を用いた構成となっているが、マイクロ波伝送線路8は実施の形態3に示すトリプレート線路及び実施の形態4に示すコプレナ線路であっても良いことは云うまでもない。この何れの場合も誘館体多層基板1と導波管6との接続面には導体15を形成し、導体15と地導体2とを接 続する複数個のスルーホール16を配置する。

0028]

実施の形態6.
以上の実施の形態1~5では、誘電体多層基板1の第2の面に形成される規則的に配列以上の実施の形態1~5では、誘電体多層基板1の第2の面に形成される規則的に配列された複数の導体パターン3の形状として正六角形としているが、上記導体パターン3の形状を三角形17とすることで、簡易な形状とすることができる。図9に実施の形態6の形状を三角形17とすることで、簡易な形状とすることができる。とか、上記三角形が正三角形でも同様な効レドトの簡単な形状で配列することができる。また、上記三角形が正三角形でも同様な効 とにより簡単な形状で配列することができる。 果が得られることは云うまでもない。

実施の形態7.

以上の実施の形態1~5では、誘電体多層基板1の第2の面に形成される規則的に配列された複数の導体バターン3の形状として正六角形としているが、上記導体バターン3の形状を四角形18とすることで、簡易な形状とすることができる。図10に実施の形態7の規則的に配列された複数の導体パターン19の配列図を示す。このような形状を用いる

簡単な形状で、かり導体パターンの 上配四角形が正方形 ことにより導政管6に方形導政管を適用した場合に、簡単な形状で、形状を切断させることなく導政管内に配列することができる。また、でも同様な効果が得られることは云うまでもない。

0030

実施の形態8

以上の実施の形態1~5では、誘電体多層基板1の第2の面に形成される規則的に配列された複数の導体パターン3の形状として正六角形としているが、上記導体パターン3の形状を変形の対角線長辺の場点を中心として120度回転させて配列した3つの菱形を上記対角線長辺の端点で接続した導体パターン19とし、スルーホール4を導体パターン19の接続に設けることでも構成することができる。図11に実施の形態8の規則的に配列された複数の導体パターン19の配列図を示す。このような形状を用いることにより隣接する事体パターン19の配列図を示す。このような形状を用いることにより隣接する導体パターンとの並列配置部分が多くなり、菱形寸法及びスルーホール4の直径等 を適宜変化させることによる特性調整の自由度が増すことができる。

(0031)

以上の実施の形態1~5では、誘電体多層基板1の第2の面に形成される規則的に配列された複数の導体パターン3の形状として正六角形としているが、上記導体パターン3の形状を正三角形20と正六角形21との導体パターンとすることでも構成することができる。図12に実施の形態9の規則的に配列された複数の導体パターン20及び21の配列 図を示す。上記正三角形20及び正六角形21の2つの形状を規則的に配列する構成とすることにより少なくとも2つ以上の周期性による配列となり、周波数特性の調整の自由度 が増すことができる。 英施の形御9

[0032]

実施の形態10

された複数の場体パターン3の形状として正式角形としているが、上記されたがある。 形状を四角形23と八角形23との場体パターンとすることでも構成することができる。 図13に実施の形態10の規則的に配列された複数の導体パターン22及び23の配列図を示す。上配四角形22及び八角形23の2つの形状を規則的に配列する構成とすることにより少なくとも2つ以上の周期性による配列となると共に、正方形22と八角形23との構成とすることにより導体面積比を大きく変化させることができ、周波数特性の調整の自由度が増すことができる。 以上の実施の形態1~5では、誘電体多層基板1の第2の面に形成される規則的に配列

[0033]

高密度, 低損失の導液管マイクロストリップ終路変験回路が実 通信、レーグ用として適用されると特に有用である。 いの窓里によれば、海型、 現でき、移動体における。 図面の簡単な説明

[0034]

【図1】この発明の実施の形態1を示す変換回路の構成図である。 【図2】この発明の実施の形態1に適用する磁気壁面検証構成図である。 【図3】この発明の反射位相特性を表す図である。 【図4】この発明の反射係数特性を表す図である。 【図5】この発明の実施の形態2を示す変換回路の構成図である。 【図6】この発明の実施の形態3を示す変換回路の構成図である。 【図6】この発明の実施の形態3を示す変換回路の構成図である。

この発明の反射位相特性を表す図である。 この発明の反射係数特性を表す図である。 この発明の実施の形態2を示す変換回路の構成図である。 この発明の実施の形態3を示す変換回路の構成図である。 この発明の実施の形態3を示す変換回路の構成図である。 この発明の実施の形態4を示す変換回路の構成図である。 この発明の実施の形態4を示す変換回路の構成図である。 この発明の実施の形態5を示す変換回路の構成図である。

|図8||この発明の実施の形態5を示す変換回路の構成図である。 |図9||この発明の実施の形態6を示す導体パターンの形状を示す図である。 |図10||この発明の実施の形態7を示す導体パターンの形状を示す図である。 |図11||この発明の実施の形態7を示す導体パターンの形状を示す図である。 |図11||この発明の実施の形態8を示す導体パターンの形状を示す図である。 この発明の実施の形態8を示す導体パターンの形状を示す図である。

この発明の実施の形態9を示す導体パターンの形状を示す図である。

この発明の実施の形態10を示す導体パターンの形状を示す図である。 図13] 符号の説明

0035

誘電体多層基板1の第1層に形成された地導体 誘電体多層基板1の第2層に形成された導体パターン

メアードーブ

跡電体多層基板1の第3層に形成されたオープンスタ 導波管

導放管の一部を欠いた部位

誘電体多層基板 1 に形成されたマイクロ波伝送線路

反射位相特性

0

メゲーボーグ 反射特性

マイクロストリップ線路地導体

トリプレート線路地導体

コプレナ線路地道体コプレナ線路地道体 ø

14 141

メゲードー

規則的配列された三角形導体パターン規則的配列された四角形導体パターン規則的配列された三菱形導体パターソ規則的配列された三菱形導体パターソ規則的配列された正三角形導体パターソ規則的配列された六角形導体パターン規則的配列された六角形導体パターン

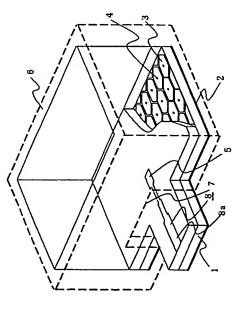
規則的配列された四角形算体パターン 規則的配列された八角形導体ペタ

【母類名】要約書 【要約】 「課題】 薄型の導液管、誘電体マイクロ液伝送線路変換回路を得る。 【解決手段】 誘電体多層基板の第1層の一方の面に形成された地導体と、同じく誘電体多層基板の第1層の他方の面に規則的に配列された導体パターンと、上記地導体と導体パターンを接続する複数のスルーホールと、誘電体多層基板の最上層に形成されるオープンスタブと、導液管の一部を欠いた部位を介して導液管外に延在する誘電体多層基板の最上層に形成され、オープンスタブと接続されたマイクロ液伝送線路との構成とする。 【選択図】図1

 \equiv

1092876748 整理番号





1210

高波数

-150 8-

(로) 타하**(**로) 8 o 양

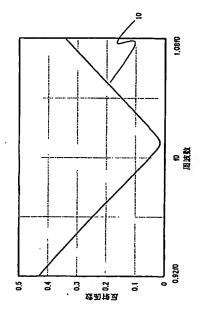
200 ₹ 5

[图3]

1:財電体多層基板 2:地導体 3:導体パケーン 4:スルーホール 5:オープンスタブ、 6: 導破管 7: 導改管の一節切り火き部位 8:マイクロ政伝送殺路

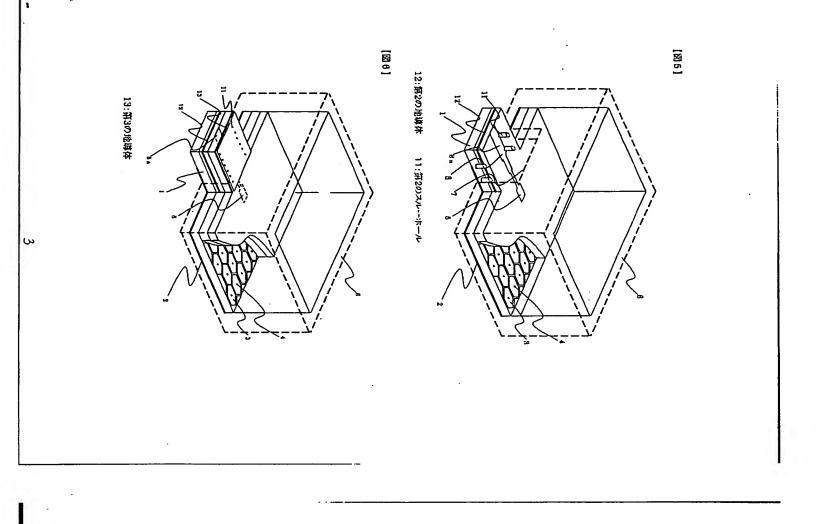
[四]

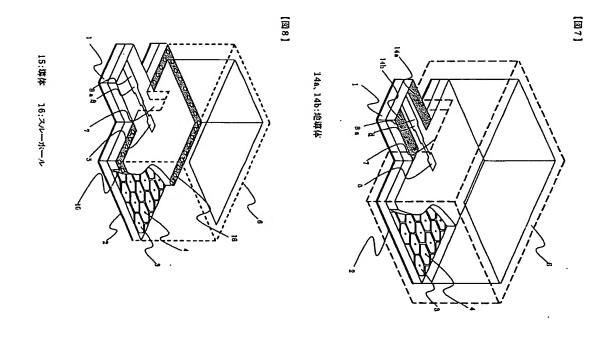
[図4]



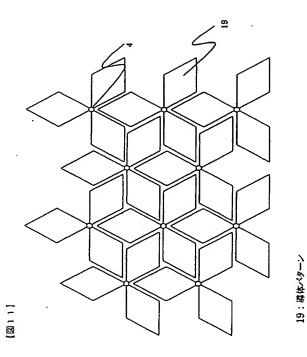
7

BEST AVAILABLE COPY



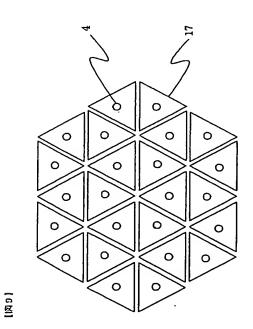


BEST AVAILABLE COPY



(212)

20、21:単体パターン



17: 路体/シーン

18: 専体パケーン

DEST AVAILABLE COPY

'n